## Nano Patrones y nano estructuras en dinámica de recubrimiento de una película delgada

## Marcel G. Clerc, Miguel Trejo, Enrique Tirapegui Departamento de Fisica, FCFM, Universidad de Chile



CIMAT

Departamento de Fisica. Facultad de ciencias Fisicas y Matematicas, Universidad de Chile.

# Dinámica de recubrimiento de una película delgada



Formación de materiales (sólidos)
La dinámica de recubrimiento tiene tres procesos básicos: adsorción, transporte y desorción.

• El modelamiento del crecimiento de películas delgada es una de las mas desafiantes actividades de la ciencia de los materiales, ya que los mecanismo de crecimiento determinan las propiedades de la película (eléctricas, elásticas, etc.) y de textura. Es de capital

interés científico y tecnológico entender y manejar los procesos de crecimiento.

Problema

Durante el proceso de recubrimiento de una película delgada, en la cual interactúa los procesos cinéticos locales y la ocurrencia simultanea de una transición de fase, uno espera encontrar formación y mecanismo de estructuras espaciales, patrones. El tamaño de estas estructuras yacen en el rango de las nanómetros.

¿ Que mecanismos originan los patrones?, ¿ que tipo de patrones uno observa?, ¿ cuál es la dinamica que describe estas etructuras?, ¿ que posibles uso pueden tener estas estructuras (device)?, etc.

Observaciones Experimentales (Nano Patrones)

Dislocations in the Ag film



-Deposición de una Monocapa Ag en rutenio(0001) a Temperatura ambiente.

-Observación de estructuras espaciales espontaneas (patrones hexagonales) e Islas de Vacancia (Nano estructuras) de tamaño nanométrico (3nm).

- K. Pohl et al, Nature, 397, 231 (1999)

## Microscopio de efecto tunel (STM)



Simulaciones Númericas

Métodos de dinámica molecular, Montecarlo y ecuaciones de reacción difusión son métodos numéricos usados para describir la dinámica de recubrimientos de películas delgadas

Dinámica Molecular (Ad-initio): desafortunadamente, los tiempos computacionales requeridos para simular una capa delgada con tasas de absorción y desorción realistas son actualmente excesivos o requieren de tasas irrealistas (miles de partículas).

Método de Montecarlo: describe pequeños películas policristalinas con dimensiones del orden del micrón (millón de partículas).

Modelos de reacción difusión: aproximación continua y macroscópica aun es interesante, ya que describe la dinámica de una película delgada de grandes dimensiones y con tasas realistas

## Simulaciones Númericas (Montecarlo)







Simulaciones numéricas usando el método de Montecarlo de deposición de aluminio sobre un sustrato amorfo (color violeta), usando deposición típica de sputtering. En la superficie se absorben dos orientaciones (Al-111 y Al-100, Transición de fase). En la figura-a se ilustran las dos fases. Cuando la temperatura es mantenida a un 1/3 de la temperatura de transición, la fase Al-111 es dominante (Fig.b). Para temperaturas menores 1/9 de la temperatura de transición domina la fase Al-100 (Fig.c)

H. Huanget al. J. Appl. Phys. 84 (1998) 3636; Thin Solid Films 365 (2000) 189

Simulaciones Númericas

Métodos de dinámica molecular, Montecarlo y ecuaciones de reacción difusión son métodos numéricos usados para describir la dinámica de recubrimientos de películas delgadas

Dinámica Molecular (Ad-initio): desafortunadamente, los tiempos computacionales requeridos para simular una capa delgada con tasas de absorción y desorción realistas son actualmente excesivos o requieren de tasas irrealistas (miles de partículas).

Método de Montecarlo: describe pequeños películas policristalinas con dimensiones del orden del micrón (millón de partículas).

Modelos de reacción difusión: aproximación continua y macroscópica aun es interesante, ya que describe la dinámica de una película delgada de grandes dimensiones y con tasas realistas

## Simulaciones de modelos continuos: Reacción-difusión





Simulaciones numéricas de una monocapa absorbida considerando los efectos del sustrato (Suo et al, Journal of nanoparticle research 2, 333 2000)

## Modelo teórico de una monocapa



Modelos continuos que describen la evolución de una monocapa incorporan procesos de reacción o cinéticos locales (adsorción y desorción) y difusión.

$$\partial_t c(\mathbf{r}, t) = R[c(\mathbf{r}, t] - \overrightarrow{\nabla} \overrightarrow{J}]$$

donde c(r,t) es el recubrimiento molecular local, R[c,t] describe los procesos de reacción y J es el flujo de corriente de masa.

Descripción microscópica basada en un modelo tipo Ising (Lattice Gas, Walgraef 2002) o ecuación maestras (Mikaelov 1999)

## Dinámica de la Monocapa

• Corriente de Difusión gobernada por variación del potencial químico  $\varphi$ :

$$\overrightarrow{J} = -M(c)\overrightarrow{\nabla}\varphi; \qquad \varphi = \frac{\delta\mathcal{F}}{\delta c} \qquad M(c) = \frac{D(c)}{K_BT}$$



## Dinámica de la Monocapa

• Corriente de Difusión gobernada por variación del potencial químico  $\varphi$ :

$$\vec{J} = -M(c)\vec{\nabla}\varphi; \qquad \varphi = \frac{\delta\mathcal{F}}{\delta c} \qquad M(c) = \frac{D(c)}{K_BT}$$

• Para calcular  $\mathcal{F}$  usamos modelo tipo Ising.

$$H = \frac{1}{2} \sum_{i,j} \epsilon_{ij} c_i c_j; \qquad \beta F = -\ln Z \qquad Z = Tr\{\exp(-\beta H)\}$$



## Dinámica de la Monocapa

• Corriente de Difusión gobernada por variación del potencial químico  $\varphi$ :

$$\vec{J} = -M(c)\vec{\nabla}\varphi; \qquad \varphi = \frac{\delta\mathcal{F}}{\delta c} \qquad M(c) = \frac{D(c)}{K_BT}$$

• Para calcular  $\mathcal{F}$  usamos modelo tipo Ising.

$$H = \frac{1}{2} \sum_{i,j} \epsilon_{ij} c_i c_j; \qquad \beta F = -\ln Z \qquad Z = Tr\{\exp(-\beta H)\}$$

• Teoría de campo medio corregida:  $F \approx F_0 + \langle H - H_o \rangle_o$ .

$$H_o = K_B T \sum_i \lambda_i c_i \qquad F_0 = K_B T \sum_i \ln(1 - \theta_i)$$



Dinámica de la monocapa

• Sea  $\theta_i = \langle c_i \rangle_o$  Primera corrección a *F* se escribe:

$$F = K_B T \sum_k [\theta_k \ln(\theta_k) + (1 - \theta_k) \ln(1 - \theta_k)] + \frac{1}{2} \sum_{ij} \epsilon_{ij} \theta_i \theta_j$$



Dinámica de la monocapa

• Sea  $\theta_i = \langle c_i \rangle_o$  Primera corrección a *F* se escribe:

$$F = K_B T \sum_k \left[\theta_k \ln(\theta_k) + (1 - \theta_k) \ln(1 - \theta_k)\right] + \frac{1}{2} \sum_{ij} \epsilon_{ij} \theta_i \theta_j$$

• Isotropía y homogeneidad:

$$\epsilon_0 = -\frac{1}{2} \sum_i \epsilon_{ij} = -\gamma \epsilon \qquad 2\xi_0^2 = \sum_{ij} \epsilon_{ij} (\vec{r_i} - \vec{r_j})^2 = 2\gamma \epsilon a^2$$



Dinámica de la monocapa

• Sea  $\theta_i = \langle c_i \rangle_o$  Primera corrección a *F* se escribe:

$$F = K_B T \sum_k \left[\theta_k \ln(\theta_k) + (1 - \theta_k) \ln(1 - \theta_k)\right] + \frac{1}{2} \sum_{ij} \epsilon_{ij} \theta_i \theta_j$$

Isotropía y homogeneidad:

$$\epsilon_0 = -\frac{1}{2} \sum_i \epsilon_{ij} = -\gamma \epsilon \qquad 2\xi_0^2 = \sum_{ij} \epsilon_{ij} (\vec{r_i} - \vec{r_j})^2 = 2\gamma \epsilon a^2$$

• Energia libre continua  $\mathcal{F}[c(r)]$ 

$$\mathcal{F} = \int_{S} dr (K_B T f(r) + \frac{1}{2} \epsilon_0^2 c(r)^2 - \frac{1}{2} \xi_0^2 |\nabla c(r)|^2)$$

$$f(r) = (1 - c(r))\ln[1 - c(r)] + c(r)\ln[c(r)]$$



## Modelo con tasa de desorción lineal.

 Si consideramos ciertos procesos de deposición:tasa de deposición constantes.

$$R[c(\mathbf{r},t)] = \alpha[1 - c(\mathbf{r},t)] - \beta c(\mathbf{r},t)$$

• El sistema tiene un funcional de Lyapunov cuando las tasa son constantes y no dependen de la cobertura

$$F = \mathcal{F} - \frac{(\alpha + \beta)}{M} \int \int d^D r d^D r' c(\mathbf{r}', t) G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') c(\mathbf{r}, t)$$

• El sistema por lo tanto puede escribirse con una energía libre efectiva.

$$\partial_t c = R[c] - M \nabla^2 \frac{\delta \mathcal{F}}{\delta c} \Rightarrow \partial_t \ c(\mathbf{r}, t) = M \nabla^2 \frac{\delta \mathcal{F}}{\delta c(\mathbf{r}, t)}$$

Por lo tanto la Dinámica es de relajación.

Modelo con Desorción lineal

• Evolución dinámica de la cobertura de una monocapa

$$\partial_t c(\mathbf{r}, t) = \alpha [1 - c(\mathbf{r}, t)] - \beta c(\mathbf{r}, t) + M \nabla^2(\varphi)$$

• Potencial químico  $\varphi$ 

$$\varphi = \epsilon_s - \epsilon_o c(\mathbf{r}, t) + K_B T \ln[\frac{c(\mathbf{r}, t)}{1 - c(\mathbf{r}, t)}] - \xi_o \nabla^2 c(\mathbf{r}, t)$$



Modelo con Desorción lineal

• Evolución dinámica de la cobertura de una monocapa

$$\partial_t c(\mathbf{r}, t) = \alpha [1 - c(\mathbf{r}, t)] - \beta c(\mathbf{r}, t) + M \nabla^2(\varphi)$$

• Potencial químico  $\varphi$ 

$$\varphi = \epsilon_s - \epsilon_o c(\mathbf{r}, t) + K_B T \ln[\frac{c(\mathbf{r}, t)}{1 - c(\mathbf{r}, t)}] - \xi_o \nabla^2 c(\mathbf{r}, t)$$

• Solución estacionaria y homogénea  $c_o = \frac{\alpha}{\alpha + \beta}$ 



Modelo con Desorción lineal

• Evolución dinámica de la cobertura de una monocapa

$$\partial_t c(\mathbf{r}, t) = \alpha [1 - c(\mathbf{r}, t)] - \beta c(\mathbf{r}, t) + M \nabla^2(\varphi)$$

• Potencial químico  $\varphi$ 

$$\varphi = \epsilon_s - \epsilon_o c(\mathbf{r}, t) + K_B T \ln[\frac{c(\mathbf{r}, t)}{1 - c(\mathbf{r}, t)}] - \xi_o \nabla^2 c(\mathbf{r}, t)$$

- Solución estacionaria y homogénea  $c_o = \frac{\alpha}{\alpha + \beta}$
- Sea  $c(\mathbf{r}, t) = c_0 + \sigma(\mathbf{r}, t)$ , perturbación a este estado.  $\sigma$  es parámetro de orden.



## Dinámica de monocapa

• La ecuación se escribe:

$$\partial_t \sigma(\mathbf{r}, t) = -\Omega \sigma + \Gamma \nabla^2 \left[ -\sigma(\mathbf{r}, t) + \mu \ln\left[\frac{c_o + \sigma(\mathbf{r}, t)}{1 - c_o - \sigma(\mathbf{r}, t)}\right] - \nabla^2 \sigma(\mathbf{r}, t) \right]$$

$$\Gamma = \frac{D\epsilon_o^2}{\xi_o^2 K_B T} \qquad \Omega = \alpha + \beta \qquad \mu = \frac{T}{4T_c}$$





c

## Estabilidad lineal

UNIVERSIDAD DE CHILE PACILIZAD DE CENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS Departamento de física





 Solución c<sub>o</sub> se deviene inestable (Walgraef 2002)

$$\lambda(k) = -\Omega - \epsilon k^2 - k^4$$

$$\epsilon = -1 + \frac{\mu}{c_o(1 - c_o)}$$

$$\epsilon_c = -2\sqrt{\alpha + \beta}$$

$$k_c = \sqrt[4]{\alpha + \beta}$$

$$T_p = 4T_c(1 - |\epsilon_c|)c_o(1 - c_o)$$

## Régimen débilmente nolineal



x=50 corresponde a 20 nm.(Para el caso de Al sobre TiN).

 $\lambda = 5.8$  nm. *Co*= 0.6;  $\Gamma = 1$  ;µ=0.1

 Estudio de selección de patrones (2D)[Walgraef(2002)]

$$\partial_t \sigma = (-\Omega + \epsilon \nabla^2 - \nabla 4)\sigma + \nabla^2 [\omega \sigma^2 + \theta \sigma^3]$$

WNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE CIERCIAS FISICAS VIATEMATICAS Departamento de físico

0.35

## Régimen débilmente nolineal



 Estudio de selección de patrones (2D)[Walgraef(2002)]

 $\partial_t \sigma = (-\Omega + \epsilon \nabla^2 - \nabla 4)\sigma + \nabla^2 [\omega \sigma^2 + \theta \sigma^3]$ 

La ecuación de amplitud(1D)

$$\partial_T A = \varepsilon A - A|A|^2 + \partial_{YY}A$$

Donde 
$$\varepsilon = \sqrt{\alpha + \beta}$$

x=50 corresponde a 20 nm.(Para el caso de Al sobre TiN):  $\sigma(x,t) = A(T = \delta \epsilon t, Y = (\delta \epsilon)^{\frac{1}{2}}x)e^{ikx} + c.c$  $\lambda = 5.8 \text{ nm}.$  Co= 0.6;  $\Gamma = 1$  ;µ=0.1



## Aplicaciones a sistemas experimentales

- Especies usadas comunmente AI,Cu,Ti,TiN,(utilizados en micromecanismos de silicio)
- Caso de Al cristaliza en FCC. a<sub>Al</sub> = 4.05[Å] a T = 293[K] (4.11[Å] a 800[K])
- Energía de interacción de pares  $\epsilon_{ij} \approx -0.0533 [eV]$ (Tiene un mínimo alrrededor de 4.1[Å])
- Deposición de atomos sobre TiN(100), $\gamma = 4$ , $\epsilon_o = 0.22[eV]$ ,  $T_c = 641[K]$
- Simulaciones de dinámica molecular.  $D = 4 \times 10^{-4} [\frac{cm^2}{s}]$  a  $T = 700[K], D = 5 \times 10^{-5} [\frac{cm^2}{s}]$  a  $T = 500[K], D = \times 10^{-7} [\frac{cm^2}{s}]$  a T = 300[K].

en estas condiciones:  $\beta = 0.1 \alpha$ ,  $c_o \approx 0.9$ ,  $T_p \approx 212[K]$ 

• Tasas del oreden de  $\Omega \approx 1 \frac{\mu m}{min}$ 

 $\lambda_c \approx 15[nm]$ 

 UNIVERSIDAD DE CHILE

 FACILIAD DE CINCAS FRECAS YMATEMATICAS

 Departamento de físico



Solución Patrón numérica para los valores:  $\mu$ =0.101;  $\Omega$ =0.005;  $\alpha$ =0.004325;  $\beta$ =0.00067;Co=0.865. En el gráfico x=50 corresponde a 20 nm, por lo tanto  $\lambda$ =32 nm



- Observamos (para c<sub>o</sub> muy bajo o muy alto) patrones muy no lineales
- Existen frentes muy no lineales que conectan solución homogénea con un patrón estable.
- No podemos atrapar este régimen con ecuaciones de amplitud.



Patrón no lineal en 3D



Región de Pinning



Esta solución numerica corresponde a un patrón localizado en la región de pinning los parámetros son: Co=0.865;  $\mu$ =0.105;  $\Omega$ =0.005;  $\alpha$ = 0.004325;  $\beta$ =0.00067.Nuevamente  $\lambda$ =32 nm.

 Estructuras localizadas y patrones localizados existen en el Pinning Range pero son muy no lineales



Patrón no lineal en 3D



Región de Pinning



Esta solución numerica corresponde a un patrón localizado en la región de pinning los parámetros son: Co=0.865;  $\mu$ =0.105;  $\Omega$ =0.005;  $\alpha$ = 0.004325;  $\beta$ =0.00067.Nuevamente  $\lambda$ =32 nm.

- Estructuras localizadas y patrones localizados existen en el Pinning Range pero son muy no lineales
- observamos frentes que conectan solución homogenea, con patrón.



Patrón no lineal en 3D



Región de Pinning



Esta solución numerica corresponde a un patrón localizado en la región de pinning los parámetros son: Co=0.865;  $\mu$ =0.105;  $\Omega$ =0.005;  $\alpha$ = 0.004325;  $\beta$ =0.00067.Nuevamente  $\lambda$ =32 nm.

- Estructuras localizadas y patrones localizados existen en el Pinning Range pero son muy no lineales
- observamos frentes que conectan solución homogenea, con patrón.



## Soluciones tipo partícula, Antidifusión



#### Vacantón



Solución numérica para los valores Co=0.865;  $\mu{=}0.105;\ \Omega{=}0.005;\ \alpha{=}0.0043;\ \beta{=}0.000675$   $\lambda{=}32$  nm.

Estructura Localizada en el rango fuertemente nolineal para los valores: Co=0.135; $\mu$ =0.101;  $\Omega$ =0.005;  $\alpha$ =0.000675;  $\beta$ =0.004325.  $\lambda$ =32nm aprox.

Viven en una region donde hay difusión



## Soluciones tipo partícula, Antidifusión



Estructura Localizada en el rango fuertemente nolineal para los valores: Co=0.135; $\mu$ =0.101;  $\Omega$ =0.005;

#### Vacantón



Solución numérica para los valores Co=0.865  $\mu$ =0.105;  $\Omega$ =0.005;  $\alpha$ = 0.0043;  $\beta$ =0.000675  $\lambda$ =32 nm.

- α=0.000675; β=0.004325. λ=**32nm aprox**.
- Viven en una region donde hay difusión
- Límite de baja adsorcion y desorción ( $\Omega \approx 0.005$ )



## Soluciones tipo partícula, Antidifusión



Estructura Localizada en el rango fuertemente nolineal para los valores: Co=0.135; $\mu$ =0.101;  $\Omega$ =0.005;

 $\alpha$ =0.000675;  $\beta$ =0.004325.  $\lambda$ =32nm aprox.

#### Vacantón



Solución numérica para los valores Co=0.865,  $\mu$ =0.105;  $\Omega$ =0.005;  $\alpha$ = 0.0043;  $\beta$ =0.000675  $\lambda$ =32 nm.

- Viven en una region donde hay difusión
- Límite de baja adsorcion y desorción ( $\Omega \approx 0.005$ )
- Ecuación tipo Cahn Hilliard debilmente perturbada



## Soluciones tipo partícula

#### Adsortón



Solución numerica en el regimen de Cahn -Hilliard perturbado. En este caso Co=0.1  $\Omega$ =0.005;  $\mu$ =0.1;  $\alpha$ =0.0045;  $\beta$ =0.0005;  $\lambda$ =31 nm.

Adsortón en 2d. Régimen Cahn-Hilliard perturbado.



Adsortón 3D. régimen Cahn-Hilliard perturbado.



Departamento de Jisica

#### Vacantón (C-H)



solución numerica de la ecuación en el régimen Cahn-Hilliard perturbado. Co=0.9;  $\Omega$ =0.005;  $\mu$ =0.1;  $\alpha$ =0.0045;  $\beta$ =0.0005;  $\lambda$ =31 nm.

Vacantón 3D Régimen Cahn-Hilliard perturbado.



Vacantón 3D. Régimen Cahn-Hilliard Perturbado



• Podemos aproximarnos a las LS considerando el límite de baja tasa de deposición y alta cobertura. $\Omega = 0.005$  y  $c_o = 0.9$ 



- Podemos aproximarnos a las LS considerando el límite de baja tasa de deposición y alta cobertura. $\Omega = 0.005$  y  $c_o = 0.9$
- Trasladando

$$\partial_t \rho = -\widetilde{\Omega}(\rho - \rho_o) + \nabla^2 [\widetilde{\epsilon}\rho + \rho^3 - \nabla^2 \rho]$$



- Podemos aproximarnos a las LS considerando el límite de baja tasa de deposición y alta cobertura. $\Omega = 0.005$  y  $c_o = 0.9$
- Trasladando

$$\partial_t \rho = -\widetilde{\Omega}(\rho - \rho_o) + \nabla^2 [\widetilde{\epsilon}\rho + \rho^3 - \nabla^2 \rho]$$

• Cuando  $\widetilde{\Omega} = 0$  tenemos Cahn-Hilliard



- Podemos aproximarnos a las LS considerando el límite de baja tasa de deposición y alta cobertura. $\Omega = 0.005$  y  $c_o = 0.9$
- Trasladando

$$\partial_t \rho = -\widetilde{\Omega}(\rho - \rho_o) + \nabla^2 [\widetilde{\epsilon}\rho + \rho^3 - \nabla^2 \rho]$$

- Cuando  $\widetilde{\Omega} = 0$  tenemos Cahn-Hilliard
- Soluciones tipo burbuja. InteracciónKink-Antikink (M.G. Clerc et al., Phys. Rev. E 71,046210 2005))

$$u_{\pm}(x, x_{\pm}(t)) = \sqrt{|\widetilde{\epsilon}|} \tanh[\sqrt{\frac{|\widetilde{\epsilon}|}{2}}(x - x_{\pm}(t))]$$
(4)



• La solución burbuja corresponde a

$$\rho(x, x_{\pm}(t)) = u_{-}(x - x_{-}(t)) - u_{+}(x - x_{+}(t)) - \sqrt{|\tilde{\epsilon}|} + \omega(x_{+}, x_{-}, x)$$



• La solución burbuja corresponde a

$$\rho(x, x_{\pm}(t)) = u_{-}(x - x_{-}(t)) - u_{+}(x - x_{+}(t)) - \sqrt{|\tilde{\epsilon}|} + \omega(x_{+}, x_{-}, x)$$

 Al reemplazar en nuestra ecuacion perturbada se despecian términos exponencialmente chicos y se llega a una ecuacion del estilo:

$$\mathcal{L}\omega = I$$

$$I \in Im(\mathcal{L})$$
  $I \perp v$   $v \in Ker(\mathcal{L}^{\dagger})$  (7)



Esto nos permite escribir el adjunto fácilmente

$$\mathcal{L}^{\dagger} = \widetilde{\epsilon} \partial_{xx} - \partial_{xxxx} + 3(u_{-} - u_{+} - \sqrt{|\widetilde{\epsilon}|})^2 \partial_{xx}$$

• Entonces si consideramos  $\partial_x \psi_{\pm} = u_{\pm}$ 

$$Ker(\mathcal{L}^{\dagger}) = \{a, bx, \psi_{+}, \psi_{-}\}$$

 Podremos encontrar una condicion de solvabilidad para el producto < 1|I >= 0 que nos dara finalmente una ecuación para el ancho de las LS

$$\dot{\Delta} = \frac{-1}{d(L)} (2\sqrt{|\widetilde{\epsilon}|}\Delta - \rho_0 \Omega L)$$

$$\Delta_{eq} = \frac{\rho_0 \Omega \ L}{2\sqrt{|\tilde{\epsilon}|}}$$



## Soluciones CH perturbado



interaccion de vacantones(C-HP)

Modelo con Desorción cuadrática

• Consideremos la ecuación para las perturbaciones

$$\partial_t \sigma(\mathbf{r}, t) = -\alpha \sigma - \beta \sigma^2 + \Gamma \nabla^2 \left[ -\sigma(\mathbf{r}, t) + \mu \ln\left[\frac{c_o + \sigma(\mathbf{r}, t)}{1 - c_o - \sigma(\mathbf{r}, t)}\right] - \nabla^2 \left[ -\sigma(\mathbf{r}, t) + \mu \ln\left[\frac{c_o + \sigma(\mathbf{r}, t)}{1 - c_o - \sigma(\mathbf{r}, t)}\right] - \nabla^2 \right]$$

• Donde:

**NIVERSIDAD DE CHILE** 

Departamento de físico

$$\alpha = \alpha_o \sqrt{1 + 4\frac{\beta}{\alpha_o}} \qquad c_o = \frac{\alpha_o}{2\beta} \left[\sqrt{1 + 4\frac{\beta}{\alpha_o}} - 1\right]$$



Dinámica de Recubrimiento durante la deposición de una película delgada - p. 25/?

Modelo con Desorción cuadrática

• Consideremos la ecuación para las perturbaciones

$$\partial_t \sigma(\mathbf{r}, t) = -\alpha \sigma - \beta \sigma^2 + \Gamma \nabla^2 \left[ -\sigma(\mathbf{r}, t) + \mu \ln\left[\frac{c_o + \sigma(\mathbf{r}, t)}{1 - c_o - \sigma(\mathbf{r}, t)}\right] - \nabla^2 \left[ -\sigma(\mathbf{r}, t) + \mu \ln\left[\frac{c_o + \sigma(\mathbf{r}, t)}{1 - c_o - \sigma(\mathbf{r}, t)}\right] - \nabla^2 \right]$$

• Donde:

**NIVERSIDAD DE CHILE** 

Departamento de físico

$$\alpha = \alpha_o \sqrt{1 + 4\frac{\beta}{\alpha_o}} \qquad c_o = \frac{\alpha_o}{2\beta} \left[\sqrt{1 + 4\frac{\beta}{\alpha_o}} - 1\right]$$



Dinámica de Recubrimiento durante la deposición de una película delgada - p. 25/?

## Desorción no lineal





El gráfico de arriba muestra la aparición del modo inestable, para ciertos valores. El gráfico de la izquierda muestra la evolución de arreglos quasihexagonales,Laberintos, patrones e islas que evolucionan er el tiempo. Corresponden a simulaciones numéricas de la ecuacion de cahn-Hilliard perturbada por un término cuadratico.



FIG. 2. (a) Quasihexagonal array of low coverage droplets at P=0.8 ( $\theta_s^{*}=0.08$ ), at late times ( $\tau=246.0$ ). (b) Interconnected structure at P=0.54 ( $\theta_s^{*}=0.013$ ) and  $\tau=170.0$ . (c) Array of high coverage droplets at P=0.4 ( $\theta_s^{*}=-0.037$ ) and  $\tau=250.0$ . (d) Emergence of ordered domains at P=0.96 ( $\tau=0.8$ ). Dark areas correspond to low coverage and light regions to high coverage. For example, in (d), black circles, white regions, and extended gray areas correspond, respectively, to coverage values of 0.3, 0.7, and 0.61 ( $=\theta_s$ ).



Patrones obtenidos numéricamente en la ecuación con desorcion cuadrática.



- Estudio numérico de formación de islas de adsorción
- Región de Histéresis
- Simulaciones numéricas de Cahn-Hilliard super critico perturbado



## Modelo con Desorción cuadrática

• Cálculo de la ecuación de Amplitud. $\sigma(\mathbf{r},t) = A(Y,T)e^{ikx} + c.c + \omega$ 

 $\partial_T A = c_1 A + c_3 A |A|^2 + c_5 A |A|^4 + 2\delta\epsilon\epsilon_c \partial_{YY} A + M\overline{A}A^3 e^{ik_c x} + |A|^4 e^{-ik_c x} +$ 



## Modelo con Desorción cuadrática

• Cálculo de la ecuación de Amplitud. $\sigma(\mathbf{r}, t) = A(Y, T)e^{ikx} + c.c + \omega$ 

 $\partial_T A = c_1 A + c_3 A |A|^2 + c_5 A |A|^4 + 2\delta\epsilon\epsilon_c \partial_{YY} A + M\overline{A}A^3 e^{ik_c x} + |A|^4 e^{-ik_c x} +$ 

 Los coeficientes c<sub>i</sub> son funciones de los parámetros del sistema. En cierto rango tendremos.(Clerc et all 2005)







 $\mu \,=\, 0 \ . \ 0 \ 0 \ 9 \ 3 \ ; \quad \alpha \,=\, 0 \ . \ 2 \ 8 \quad ; \ \beta \,=\, 0 \ . \ 1 \ 6 \ ; \quad \textbf{C o = 0} \ . \ 5 \ 5$ 

Ноуо



Misma región de parámetros que PL



Patrón Localizado en 3D





Frozen island



Frozen island 3D



- Aparición de dominios de lenta evolución en zona cercana al pinning range (Frozen island)(Verdasca et all)
- Frente cubre toda la región luego de un tiempo.



Patrón lacalizado



 $\mu = 0 . 1 8 ; \quad \alpha = 0 . 0 0 6 ; \\ \beta = 0 . 0 0 2 ; \quad C o = 0 . 6 9$ Patron Localizado en 2D



 Patrón Localizado altamente no lineal.Región de Pinning Range





Patrón no lineal



C o = 0 . 8 6 2 ;  $\mu$  = 0 . 1 ;  $\alpha$  = 0 . 0 0 5 ;  $\beta$  = 0 . 0 0 7

Patrón localizado



 $\label{eq:constraint} \textbf{C} ~ \textbf{o} ~ \textbf{=} ~ 0 ~ . ~ 8 ~ 3 ~ 7 ~ ; ~ ~ \mu ~ \textbf{=} ~ 0 ~ . ~ 1 ~ 1 ~ 7 ~ ; ~ \alpha ~ \textbf{=} ~ 0 ~ . ~ 0 ~ 0 ~ 6 ~ ; ~ \beta ~ \textbf{=} ~ 0 ~ . ~ 1 ~ 6 ~ .$ 

- Persisten soluciones de desorción lineal para bajas tasas de deposicion.
- Se observa región de Pinning.



# Conclusiones

Durante el proceso de recubrimiento de una monocapa, en la cual interactúan los procesos cinéticos locales y la ocurrencia simultánea de una transición de fase, el sistema exhibe la formación espontánea de estructuras espaciales (nano estructuras, patrones y estructuras localizadas).

Patrones, estructuras localizadas (islas de vacancia o adsorción), y patrones localizados, pueden observarse en modelos con tasas de deposición lineal y no lineal lejos del punto de transición.

Aproximaciones tipo Cabn-billiard perturbado nos permite analiticamente explicar los vacantones y absorbones .

Una ecuación de amplitud forzada espacialmente nos permite explicar analíticamente la aparición de patrones localizados.

## **Prospectos Futuros**





## Superpeacks



- Estudio numérico y teórico de Estructuras localizadas "Superpeacks".
- Estudio de modelos que involucren difusión no lineal. superficial

